# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-263717

(43)Date of publication of application: 20.09.1994

(51)Int.CI.

CO7C311/51 CO8F 20/38

(21)Application number: 05-311773

(71)Applicant: HOECHST AG

(22)Date of filing:

13.12.1993

(72)Inventor: EICHHORN MATHIAS DR

**BUHR GERHARD** 

(30)Priority

Priority number: 92 4242050

Priority date: 14.12.1992

Priority country: DE

# (54) POLYMER HAVING N,N-DISUBSTITUTED SULFONAMIDE PENDENT GROUP AND USE OF THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a compounds which can be produced easily and economically and are cleavable by a film, suitable to a positive 'chemically strengthened' mixture highly sensitive to chemical radiation particularly to a radiation from an exima laser and a high pressure mercury lamp.

CONSTITUTION: These are the polymers having a unit containing at least ≥5 mole %, preferably in particular 20 to 80 mole % pendent groups represented by formula I or II. As polymers having the groups of formula I, there are, for example, compounds shown by formula III (wherein R4 is H or methyl), as the compounds having the groups of formula II, for example, there are compounds shown by formula IV, mol.wt. of the polymers is 2,000 to 100,000, preferably 5,000 to 50,000. The compounds as (A) a compound which forms a layer under the influence of chemical radiation, and (B) a compound cleavable by a film and its cleavage products in an aqueous-alkaline developer have a higher solubility than the starting compound, are formulated for preparing the radiationsensitive mixture. In formulae I, II, R1 is alkyl, cycloalkyl, aryl or aralkyl; R2 is alkyl, alkenyl or aralkyl; R3 is nonsubstituted or substituted alkyl, cycloalkyl, aryl or aralkyl.

$$R_i = N \cdot (C \cdot O - O \cdot R_i^{-1}) - S \cdot O^{s} \cdot - R_i$$

$$R^{1} = SO_{2} = N (CO + OR^{2}) = R^{3}$$

$$O CO CR^{2} = CH_{2}$$

$$R^{1} = N (CO + OR^{1}) + SO_{2} = R^{1}$$
  
=  $O + CO + CR^{1} = CH_{1}$ 

W

ĩ

Π

Dŧ

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

20.10.2000

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(12)公開特許公報

(19)日本国特許庁 (JP)

(11)特許出顯公開番号

特開平 6-263717

(43) 公開日 平成6年 (1994) 9月20日

(51) Int. C1. 5

識別記号

MMU

FΙ

C07C311/51

7419-4H

C08F 20/38

7242-4J

審査請求 未請求 請求項の数 10 OL

(21)出願番号	特願平 5-311773	(71)出願人	590000145
			ヘキスト・アクチェンゲゼルシャフト
(22)出願日	平成5年 (1993)12月13日		ドイツ連邦共和国、 65926 フランクフル
			ト・アム・マイン(番地なし )
(31)優先権主張番号	P4242050.4	(72) 発明者	マティアス、アイヒホルン
(32)優先日	1992年12月14日		ドイツ連邦共和国ニーデルンハウゼン、ア
(33) 優先権主張国	ドイツ (DE)		ム、フェルゼンケラー、 33アー
		(72)発明者	ゲルハルト、ブール
			ドイツ連邦共和国ケーニッヒシュタイン、
			アム、エルトペールシュタイン、 28
		(74)代理人	弁理士 佐藤 一雄 (外2名)
		1	

(54)【発明の名称】 N, N-二置換スルホンアミド懸垂基を有する重合体およびその使用

### (57)【要約】

【目的】 オフセット印刷板およびフォトレジストの製 造に特に好適であるモノマーおよび放射線感応性記録の 提供。

#### 【構成】 式

 $R^{1} - SO_{2} - N (CO - OR^{2}) - R^{3} - O - CO CR' = CH_1 \implies UR^1 - N(CO - OR^2) - SO$ , -R' -O-CO-CR ' = CH, のモノマー、なら びに、少なくとも 5 モル%の、式-R ³-N (CO-O  $R^{1}$ ) -SO, -R<sup>1</sup> (I)  $3 \pm U/\pm c t - R$  <sup>1</sup> -S O, -N (CO-OR ') -R' (II)の懸垂基を有する 単位を有する重合体、および

- a) 化学線放射の影響下で酸を形成する化合物、および
- b) 酸により開裂し得る化合物であって、その開裂生成 物がその出発化合物より水性-アルカリ性現像剤中で高 い溶解性を有する化合物

を含む放射感応性混合物であって、酸により開裂し得る 化合物が上記の種類の重合体である混合物、および支持 体および放射線感応性層を含む記録材料。

2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】式R ¹ -SO; -N(CO-OR²) -R
³ -O-CO-CR' = CH; またはR¹ -N(CO-OR²) -SO; -R³ -O-CO-CR' = CH; の
化合物 [式中、R¹ は (C; ~C; ) アルキル、(C; ~C; ) シクロアルキル、(C; ~C; ) アリールまたは(C; ~C; ) アラルキル基であり、アルキルを含む
基中の個々のメチレン基は所望によりヘテロ原子により
置換されており、R² は(C; ~C; ) アルキル、(C; ~C; ) アルケニルまたは(C; ~C; ) アルキル
基であり、R³ は非置換または置換(C; ~C; ) アルキル
キレン、(C; ~C; ) シクロアルキレン、(C; ~C; ) アリーレンジアル
キル基であり、R⁴ は水素原子またはメチル基である。]。

【請求項2】R<sup>2</sup>が、(C, ~C, )アルキル基、好ましくはイソプロビル、sec-ブチルまたはt-ブチル基、である、請求項1に記載の化合物。

【請求項3】少なくとも5モル%の、式一R 3 -N(CO-OR')-SO:-R'(I)および/または一R -SO:-N(CO-OR')-R'(II)(式中、R'は(C, ~C;0)アルキル、(C, ~C;0)シクロアルキル、(C, ~C;0)アリールまたは(C, ~C;0)アラルキル基であり、アルキルを含む基中の個々のメチレン基は所望によりへテロ原子により置換されており、R'は(C, ~C;1)アルキル、(C, ~C;1)アルケニルまたは(C, ~C;1)アルキル表であり、R'は非置換または置換(C, ~C;1)アルキル、(C, ~C;0)アシクロアルキル、(C, ~C;0)アリールまたは(C, ~C;0)アラルキル基である。]の懸垂基を含む単位を有することを特徴とする重合体。

【請求項4】基R <sup>2</sup> が、イソプロビル、secープチルまたはtープチル基である、請求項3に記載の重合体。 【請求項5】 a)化学線放射の影響下で酸を形成する化合物、および

b) 酸により開裂し得る化合物であって、その開裂生成物が水性-アルカリ性現像剤中でその出発化合物よりも高い溶解性を有する化合物を含んでなる放射線感応性混合物であって、酸により開裂し得る化合物b) が請求項3または4に記載の重合体であることを特徴とする放射線感応性混合物。

【請求項6】酸を形成する化合物 a)の比率が、混合物中の固体の総重量に対して約0.1~20重量%、好ましくは0.2~10重量%、である、請求項5に記載の放射線感応性混合物。

【請求項7】酸により開裂し得る化合物b)の比率が、混合物中の固体の総重量に対して約30~98重量%、好ましくは50~95重量%、である、請求項5に記載の放射線感応性混合物。

【請求項8】さらに、有機重合体状パインダーを含んで

なる、請求項5に記載の放射線感応性混合物。

【請求項9】 重合体状パインダーの比率が、混合物中の 固体の総重量に対して約5~70重量%、好ましくは2 0~50重量%、である、請求項8に記載の放射線感応 性混合物。

【請求項10】支持体および放射線感応性層を含んでなる記録材料であって、前記層が請求項5~9のいずれか 1項に記載の放射線感応性混合物を含んでなることを特 徴とする記録材料。

#### 10 【発明の詳細な説明】

【0001】本発明は、N, N-二置換スルホンアミド 基を有するモノマー、N, N-二置換スルホンアミド 懸垂基を有する重合体、および下記の a) ~ c) を含んで なる放射線感応性混合物に関するものである。

- a) 化学線放射の影響下で酸を形成する化合物、
- b) 酸により開裂し得る化合物であって、その開裂生成物が水性-アルカリ性現像剤中でその出発化合物よりも高い溶解性を有する化合物、および
- c) 水には不溶であるが、アルカリ水溶液中に可溶であ 20 るか、または少なくとも膨潤し得る重合体状パインダ

【0002】オフセット印刷版およびフォトレジストの 製造には、基材および放射線感応性層を含む記録材料が 特に好適である。

【0003】ポジ型放射線感応性記録層、すなわち照射された区域における溶解性が照射されていない区域における溶解性よりも大きい層、は公知である。その様な層における感光性成分としては、オルトーナフトキノンジアジドが特に広く使用されている。しかし、これらの層の光感度は一般的に十分ではない。

【0004】対照的に、いわゆる「化学的に強化された」混合物は、量子収率が1より大きいので、より高い 光感度を示す。ポジ型の「化学的に強化された」混合物 は、一般的に酸形成化合物および酸により開裂し得る化 合物を含み、その開裂生成物は元の化合物よりも水性ア ルカリ現像剤に対する溶解性が高い。

【0005】これまで使用されている酸により開裂し得る化合物は、ヒドロキシルまたはアミノ成分として芳香族化合物(US-A 3779778号明細書)および40 オルトエステルおよびアミドアセタール(DE-B 610842号明細書)を含む単量体および重合体アセタールおよびの、N-アセタールである。放射線感応性ポジ型混合物は、重合体オルトエステル(EP-B 022571号明細書)、重合体脂肪族アセタール(DE-A 2718254号明細書)、エノールエーテル(EP-B 0006627号明細書)およびN-アシルイミノ炭酸エステル(EP-B 0006626号明細書)を使用しても得られる。この種の混合物は、開裂反応を開始させるために、光化学的に発生させた酸だけ50ではなく、水をも必要とするので、実際の用途において

は5,000~50,000、である。

問題が生じる。その上、これらの化合物の多くは容易に 入手できない。

【0006】 照射により酸を生じる化合物を含み、懸垂した、酸に敏感な t ー プトキシカルポニルまたは t ー プトキシカルポニルオキシ基を有する重合体をも含むポジ型放射線感応性混合物は E P ー A 0366590号明細書に記載されている。類似の、ただし酸重合体の代わりに酸に敏感な基を有する低分子量化合物を含む、混合物は E P ー A

0249139号明細書に開示されている。一般的に、分子量が1000未満である低分子量化合物における酸に敏感な基としては、特にtーブトキシ、tープトキシカルポニル、tーブトキシカルポニルオキシ、1ーメチルー1ーフェニルエトキシカルポニルおよびトリメチルシラニルオキシ基が開示されている。その様な系は開裂反応に水を必要としないが、欠点が無い訳でもない。例えば、これらの系は比較的高い「ダークアプレーション」(dark ablation)を示す、すなわち現像剤に対する放射線感応性層の溶解度が非露光領域においても比較的高く、そのために露光領域と非露光領域の間の差がテレくなる。

【0007】本発明の目的は、簡単で、経済的に製造することができ、化学線放射ー特にエキシマレーザーや高圧水銀ランブからの放射線に対する感度が高いポジ型の「化学的に強化された」混合物に特に好適な、酸により開裂し得る化合物を開発することである。

レン、 (C , ~ C , , ) シクロアルキレン、 (C , ~ C , , ) アリーレンまたは (C , ~ C , , ) アリーレンジアルキル基である。) の N , N - 二 置換スルホンアミド基を有するモノマー、および少なくとも5 モル%の、式 I および/または IIの懸垂基を含む単位を有する重合体により達成される。

【0009】 R  $^2$  は、好ましくは(C ,  $\sim C$  。) アルキル基、特に好ましくはイソプロビル、 s e c - プチル基 たは t - プチル基、である。

【0010】例が示す様に、重合体は好ましくは10~90モル%、特に好ましくは20~80モル%、の、式 Iまたは IIの基を有する単位を含む。したがって、一般 的に単独重合体よりも共重合体が好ましい。重合体の分 子量は一般的に2,000~100,000、好ましく

【0011】好適なコモノマーは、一般的に、酸により 開裂し得る基を含まないすべての重合可能な化合物であ る。「酸により開裂し得ない」とは、本明細書では、そ れらの基が本発明による混合物中で生じる酸により開裂 しないことを意味する。その様なコモノマーは、例えば アクリル酸、メタクリル酸、 (C 1 ~ C10) アルキルの アクリル酸エステルおよびメタクリル酸エステル、(C 。~C 10) アリールのアクリル酸エステルおよびメタク 10 リル酸エステル (特にアクリル酸フェニル、メタクリル 酸フェニルおよびモノメタクリル酸ピロカテコール)、 アクリルアミド、メタクリルアミド、所望により置換し たN-(C 1 ~ C 10) アルキルのアクリルアミドおよび メタクリルアミド (特にN- (2-ヒドロキシエチル) のアクリルアミドおよびメタクリルアミド)、N, N-ジ (C 1 ~ C 10) アルキルアクリルアミド、Nーフェニ ルのアクリルアミドおよびメタクリルアミド、N, N-ジフェニルのアクリルアミドおよびメタクリルアミド、 N- (C₁ ~C₁₀) アルキル-N- (C ₀ ~C₁₀) アリ 20 ールアクリルアミド (特にN-フェニルーN-メチルの アクリルアミドおよびメタクリルアミド)、N-フタル イミドメチルメタクリルアミド、アリル化合物、例えば アリルエステルおよびアリルオキシエタノール、ビニル 化合物、例えばピニルエーテルおよびビニルエステル、 ピニル芳香族化合物、例えばスチレン、アルキルスチレ ン、アルコキシスチレン、ヒドロキシスチレン、アルキ ルヒドロキシスチレン、アセトキシスチレン、αーメチ ルスチレン、α-メチルヒドロキシスチレン、そして**最** 後にアクリロニトリルおよびメタクリロニトリルであ 30 る。それ程好ましい訳ではないが、ある種の条件下で は、酸により開裂し得る基を含むコモノマーを使用する

【0012】式IのN, N-二置換スルホンアミド基を有する好ましいモノマーは、R '-SO; -N (CO-OR')-R'-O-CO-CR'=CH; であり、式IIの基を有する好ましいモノマーは、R '-N (CO-OR')-SO; -R'-O-CO-CR'=CH; である (ここで、R'は水素原子またはメチル基である)。したがって好ましいモノマーはアクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステルである。

【0013】N、N-二置換スルホンアミド基を有するモノマーは、対応するN-一置換スルホンアミド基を有する化合物を、触媒量の有機塩基、例えば4-ジメチルアミノビリジン、の存在下で、アルコール成分として基-OR<sup>1</sup>を含む活性化炭酸エステルと反応させることにより製造できる。

【0014】N-一置換スルホンアミドは、当業者には 公知の方法により、スルホン酸および第一級アミンから 製造することができる。式 IIの基を有するモノマーの製

50 造では一般的にモノアミンを使用する。好ましいモノア

ミンは、1~12個、特に好ましくは1~6個、の炭素 原子を有する直鎖または分枝鎖のアルキルアミン、例え ·ばメチルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、イソ プロピルアミン、プチルアミン、Sec-ブチルアミ ン、イソプチルアミン、t-プチルアミン、ペンチルア ミン、1-メチルプチルアミン、2-メチルプチルアミ ンおよびヘキシルアミンである。また、3~12個、特 に好ましくは5~8個、の炭素原子を有するシクロアル キルアミン、例えばシクロペンチルアミン、シクロヘキ シルアミン、シクロヘブチルアミンおよびシクロオクチ ルアミンも好ましい。芳香族モノアミンの中では、6~ 15個の炭素原子を有するアミンが好ましく、それらの 芳香族部分は特にハロゲン原子、アルキルまたはアルコ キシ基で置換することができる。好ましい芳香族アミン の例としては、アニリン、4-メチルアニリン、4-エ チルアニリン、4-メトキシアニリン、3-メトキシア ニリン、4ーエトキシアニリン、4-フェノキシアニリ ン、ナフチルアミン、ビフェニルアミン、1-および2 ーアミノアントラセンおよび9-アミノフェナントレン がある。アラルキルアミンの中で、7~20個の炭素原 子を有する化合物が好ましい。これらの化合物は芳香族 アミンと同様に置換されていてもよい。それらの例とし ては、ペンジルアミン、4-メトキシペンジルアミン、 2、2-および3、3-ジフェニルプロピルアミンがあ

【0015】式Iの基を有するモノマーの製造には、重合可能なオレフィン性不飽和基またはその様な重合可能な基と結合する官能基を有する第一アミンを使用する。上記のアクリル酸エステルおよびメタクリル酸エステルの製造に特に好適なのはヒドロキシアミン、例えばエタノールアミン、である。その水酸基を例えば無水メタクリル酸と反応させることにより、重合可能な二重結合を導入することができる。

【0016】モノマーの製造に使用するスルホン酸には、アミンと同じことが言える。式 I の基を有するモノマーの製造に好ましいスルホン酸は、メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、エタンスルホン酸、プロバンスルホン酸、ペルフルオロブタンスルホン酸、ヘキサンスルホン酸、ペルフルオロブタンスルホン酸、ペンゼンスルホン酸、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸、パラートルエンスルホン酸およびナフタレンスルホン酸である。したがって、式 IIの基を有するモノマーの製造には、式 I の基を有するモノマーを製造するためのアミンと同様に官能化されたスルホン酸を使用する。官能化されたスルホン酸の例は4ーヒドロキシベンゼンスルホン酸である。

【0017】反応には一般的にスルホン酸をそのままでは使用せず、反応性がより高い、いわゆる「活性化された」形で使用する。これらの化合物には、特にハロゲン

化スルホニル、とりわけ塩化スルホニル、がある。
【0018】いわゆる「活性化された炭酸エステル」は、N-一置換スルホンアミドを一COIOR \* でアシル化できる化合物である。これらの化合物は、特に、二炭酸ジアルキル (=ピロ炭酸ジアルキルエステル) である。特に好ましいのは二炭酸ジー t ープチル (=〇 [C O; -C (CH,),],],)である。

【0019】N-一置換スルホンアミドと活性化炭酸エ ステルの反応は、反応条件下で反応混合物の他の成分と 10 不可逆的な反応を起こさない溶剤中で、N--置換スル ホンアミドのモル量に対して0.01~10モル%、好 ましくは0.05~2モル%、の有機塩基の存在下で行 うのが好ましい。該塩基は好ましくは第三級アミン、例 えばジアルキルアミノビリジン、である。好適な溶剤 は、特にテトラヒドロフラン、酢酸エチル、ジエチルエ ーテル、プタノン (=メチルエチルケトン) である。 N -- 間換スルホンアミドおよび有機塩基を溶解した形で 最初に導入し、この混合物に活性化された炭酸エステル を徐々に加えるのが有利であることが分かった。反応は 20 一般的に0~80℃、好ましくは10~50℃、の温度 で行う。次いで反応混合物を水中に注ぎ込み、沈殿物を 濾過し、乾燥させるか、あるいは減圧下で単純に揮発性 成分を除去することにより、反応生成物を十分な純度で 分離することができる。必要であれば、再結晶、再沈 殿、蒸留により、あるいは分取クロマトグラフィー法に より、さらに精製することができる。

【0020】本発明はさらに、

a) 活性線放射の影響下で酸を形成する化合物、および b) 酸により開裂し得る化合物であって、その開裂生成 30 物が水性ーアルカリ性現像剤中でその出発化合物よりも 高い溶解性を有する化合物

を含む放射線感応性混合物であって、酸により開裂し得る化合物 b) が式 I または IIのN, N-二置換スルホンアミド懸垂基を有する単位を少なくとも 5 モル%有する 重合体である混合物を提案するものである。

【0021】化学線放射の影響下で好ましくは強酸を形成する化合物 a)としては、とりわけ、ジアゾニウム、ホスホニウム、スルホニウムおよびヨードニウム塩、ハロゲン化合物、0ーキノンジアジドスルホクロリド、エ 40 ステルおよびアミドおよび有機金属/有機ハロゲンの組合わせが好適である。該ジアゾニウム、ホスホニウム とのおよびヨードニウム化合物は、原則として、有機溶剤に可溶なそれらの塩の形で、特にスルホニウムおよびヨードニウム化合物は、原則として、有機溶剤に可溶なそれらの塩の形で、特にスルホン酸塩、ヘキサフルオロリン酸塩、ヘキサフルオロアンチモン酸塩またはヘキサフルオロアンチモン酸塩またはヘキサフルオロアンチモン酸塩またはヘキナフトキノンラアジドスルホン酸のハロゲン化物、エステルおよびアミドを使用することもできる。しかし、0ーキノンジアジドを照射することにより形成されるインデンカルボン酸

7

の酸性度は、十分な画像形成にはほとんど適していな い。したがって、この群の中で、照射により3つの酸機 能が形成されるので、比較的大きな強化ファクターが得 られる 1、 2 - ナフトキノン- 2 - ジアジド- 4 - スル ホニルクロリドが好ましい。最後に、好適な酸形成剤に は、有機ハロゲン化合物、例えば炭素原子または芳香族 環の上に1個より多いのハロゲン原子を有する化合物も 含まれる。酸ハロゲン含有化合物のスペクトル感度は、 それ自体公知の増感剤により増加させることができる。 特に好適な酸形成剤の例は、1,2-ナフトキノン-2 -ジアジドー4-スルホニルクロリド、4-ジープロピ ルアミノペンゼンジアゾニウムのテトラフルオロホウ酸 塩、ヘキサフルオロリン酸塩およびトリフルオロメタン スルホン酸塩、2,5-ジ-エトキシ-4-p-トリル メルカプトペンゼンジアゾニウムのテトラフルオロホウ 酸塩、ヘキサフルオロリン酸塩およびトリフルオロメタ ンスルホン酸塩、4-アニリノベンゼンジアゾニウムの 硫酸塩および4-ジエチルアミノベンゼンジアゾニウム のトリフルオロメタンスルホン酸塩、ならびに実施例の 項に記載の化合物である。4-メチルー6-トリクロロ メチルー2-ピロン、4-(3,4,5-トリメトキシ スチリル) -6-トリクロロメチル-2-ピロン、4-(4-メトキシスチリル) -6- (3, 3, 3-トリク ロロプロペニル) -2-ピロン、2-トリクロロメチル ベンズイミダゾール、2-トリプロモメチルキノリン-4ーオン、2,4ージメチルー1ートリプロモアセチル ペンゼン、3-ニトロ-1-トリプロモアセチルベンゼ ン、4-ジプロモアセチル安息香酸、1,4-ビス-ジ プロモメチルーペンゼン、置換4,6-ピスートリクロ ロメチルー s ートリアジン、例えば 2 ー (6 ーメトキシ ナフタレンー2-イル)-、2-(ナフタレン-1-イ  $\nu$ ) -、2-(ナフタレン-2-イル) -、2-[4-(2-エトキシエチル) ーナフタレンー1ーイル] ー、 2-ベンゾピラン-3-イル、2-フェナントレン-9 ーイルーおよび2-(4-メトキシアントラセン-1-イル) -4,6-ピスートリクロロメチル-s-トリア ジンおよびトリスージプロモメチルーsートリアジンを 使用することもできる。

【0022】混合物中の酸形成剤 a)の比率は混合物の組成により異なる。混合物中の固体の総重量に対して約0.1~20重量%、好ましくは0.2~10重量%、で良好な結果が得られている。特に厚さが10μ ロ を超える複写層の場合、比較的少量の酸形成剤を使用するのが有利である。

【0023】酸により開裂し得る重合体b)の比率は、 混合物中の固体の総重量に対して一般的に約30~98 重量%、好ましくは50~95重量%、である。

【0024】 本発明による、酸により開裂し得る化合物に加えて、混合物中には他の物質も存在できる。これらの物質は、特に t ープトキシカルボニル基を含む重合体

である。しかし、その様な酸により開裂し得る他の化合 物を含む混合物は一般的に好ましくない。

【0025】必要であれば、混合物はさらに重合体状有機パインダーを含むことができる。特に好適な重合体状パインダーはフェノール樹脂、特にクレゾールーホルムアルデヒドノボラック(融点がDIN53181により110~120℃)、である。

10 【0026】パインダーの種類および量は用途により異なるが、混合物中の固体の総重量に対して好ましくは5~70重量%、特に好ましくは20~50重量%、である。

【0027】酸の作用によりアルカリ溶解性が増加する
パインダーも、本発明の混合物中に使用できる。その様
なパインダーは、例えばポリヒドロキシスチレンであっ
て、そのフェノール性OH基は、アルカリ溶解性を下げ
る、酸に敏感な基を備えている。本発明による化合物
は、混合物の感光性に悪影響を及ぼさずに、ダークアブ
20 レーションを著しく低下させる。

【0028】他のアルカリ可溶性樹脂、例えばメタクリル酸およびメタクリル酸メチル、酢酸ピニルおよびクロトン酸、ならびに無水マレイン酸およびスチレンから得られる共重合体、も同様にパインダーとして好適である。

【0029】さらに、他の多くの樹脂、好ましくはビニル重合体、例えばポリ(酢酸ビニル)、ポリアクリル酸エステル、ポリ(ビニルエーテル)、およびポリ(ビニルビロリドン)、も同時に使用できるが、これらの樹脂の最も有利な比率は使用上の必要条件および現像条件に対する影響により異なる。その比率は一般的に、混合物中の固体の総重量に対して50重量%以下である。

【0030】特殊な要件、例えばたわみ性、接着性または光沢、を満たすために、放射感応性混合物はさらにポリグリコール、セルロース誘導体、例えばエチルセルロース、湿潤剤、染料および細かく分散した顔料、の様な物質を含んでよい。特に有用であることが分かっている染料は、特にカルビノール塩基の形のトリフェニルメタンである。各成分の最も有利な量的比率はそれぞれの場合に対して実験により容易に見出だすことができる。

【0031】 最後に、本発明は基材および本発明の混合物を含む放射線感応性層を含む記録材料にも関する。 記録材料は通常、基材を混合物の溶液で被覆することにより製造される。

【0032】本発明の放射線感応性混合物に好適な溶剤は、(イ)ケトン、例えばメチルエチルケトン、(ロ)塩素化炭化水素、例えばトリクロロエチレンや1,1,1ートリクロロエタン、(ハ)アルコール、例えばnープロパノール、(ニ)エーテル、例えばテトラヒドロフ

q

ラン、 (ホ) グリコールエーテル、例えばエチレングリ コールモノエチルエーテル、および (へ) エステル、例 えば酢酸プチル、である。また、特殊な目的のために溶 剤、例えばアセトニトリル、ジオキサンまたはジメチル ホルムアミド、をさらに含むことがある混合物を使用す ることも可能である。原則的に、層の成分と不可逆的に 反応しないすべての溶剤を使用することができる。しか し、溶剤は、意図する塗布方法、層の厚さおよび乾燥装 置を考慮して選択されるべきである。実験的な量で約5 μπ までの薄い層は、好ましくはスピンコーティングに より塗布する。60 µ m を超える層厚は、固体含有量が 約40%までの溶液を、回転ディスクに1回塗布するこ とにより、またはドクターナイフを使用することによ り、達成できる。両面コーティングは好ましくは浸し塗 りにより行い、表面を急速に乾燥させるのが有利であ り、これは低沸点溶剤を使用して行うことで達成され る。細片状の基材にはシートダイスを使用してコーティ ング溶液をスプレーすることにより、あるいはローラー を使用して塗布することができる。各種の板、例えば亜 鉛または多金属板、はカーテンコーティングにより被覆 することができる。

【0033】他のポジ型層、特にoーナフトキノンジアジド系の層と比較して、本発明の混合物の感光性は厚さによりあまり変化しないので、より厚い層を形成することもできる。厚さが100μ m以上の層を露光および処理することも可能である。

【0034】 層厚が10μ m を超える場合に好適な基材 はプラスチックシートであり、これは転写層のための一 時的な基材として役立つ。この目的およびカラーシート には、ポリエステル、例えばポリエチレンテレフタレー ト製、のシートが好ましい。しかし、ポリオレフィン、 例えばポリプロピレン、のシートも同様に好適である。 層の厚さが10μ π 未満である場合、使用するフィルム 基材は通常は金属である。オフセット印刷板は、機械的 に、または電気化学的に粗面化し、所望によりアノード 処理したアルミニウムを使用して製造できるが、そのア ルミニウムは化学的に前処理(例えばポリビニルホスホ ン酸、ケイ酸塩またはリン酸塩で) することができる。 また、最上層としてСu/Crまたは黄銅/Crを有す る多金属板も好適である。凸版印刷板の製造には、本発 明の混合物から製造した層を亜鉛またはマグネシウム 板、またはパウダーレスエッチングにはそれらの市販の 微結晶合金に、あるいはエッチング可能なプラスチッ ク、例えばポリオキシメチレン、に塗布することができ る。ロトグラビアまたはハーフトーン版用には、これら の層が、良好な密着性および銅またはニッケル表面上の 耐侵食性のために好適である。同様に、これらの層はフ ォトレジストおよび化学研削にも使用できる。

【0035】 最後に、絶縁板の片面または両面を銅で被 優したプリント回路基板、所望により前処理して密着性 を強化したガラスまたはセラミック材料、およびとりわけ、所望により表面に窒化物または酸化物の層を有することがあるシリコンウエハー、上に、直接、または一時的な基材から乾燥した層を転写することにより、コーティングを施すことができる。さらに、木、織物、および投影により画像形成するのが好ましく、アルカリ性現像剤に対して耐性がある多くの材料、の表面に被覆することができる。

【0036】コーティングは、通常の装置を使用し、通 10 常の条件下で乾燥させることができる。コーティングは 100℃前後の温度に、短時間ならば120℃までの温 度に、放射線感応性が失われることなく、耐えることが できる。

【0037】照射は、放射線光源、例えば管状ランプ、パルス状発光キセノンランプ、金属ハロゲン化物でドーピングした高圧水銀蒸気ランプおよびカーボンアークランプ、を使用して行うことができる。さらに、従来の投影拡大装置で、金属フィラメントランプの下で照射することができる、あるいは通常の電球を使用して接触露光20 することもできる。あるいは、レーザーの干渉光で照射を行うこともできる。この目的に好適なレーザーは、高出力短波長レーザー、例えば193~633 nmの光を発生する、アルゴンイオンレーザー、クリプトンイオンレーザー、ダイレーザー、ヘリウムーカドミウムレーザーおよびエキシマレーザーである。レーザーは通常、コンピュータ制御でラスターまたはストローク状に記録層を通過させ、像様に照射する。

【0038】電子線の照射によっても画像形成することができる。電子線は、他の多くの有機材料と同様に、本 30 発明による混合物を完全に分解し、次いで架橋させることができるので、非照射区域を溶剤により、あるいはバターンを使用せずに露光し、現像することにより陰画像を形成することができる。電子線の強度がより低い、および/またはその書き込み速度が高い場合、電子線は反対に溶解度が高い方向で画像形成効果を有する、すなわち照射された層の部分を現像剤により除去することができる。選択すべき最も好ましい状態は実験により容易に決定することができる。

【0039】像様に露光または照射した層は、必要であれば熱的な二次処理の後、市販のナフトキノンジアジド層およびフォトレジスト用の現像剤と事実上同じ現像剤で除去することができ、これらの新規な層は、それらの複写条件に関する限り、従来の手段、例えば現像剤やブログラム化したスプレー現像装置、に効果的に適合させることができる。現像剤水溶液は、例えばアルカリ金属のリン酸塩、ケイ酸塩または水酸化物を含み、さら場合により、水性アルカリ現像剤の代わりに、有機溶剤と水の混合物を現像剤として使用することもできる。しかし、好ましい現像剤はアルカリ水溶液であ

る。

【0040】最も有利な現像剤は、それぞれの場合の層で実験することにより決定できる。必要であれば、現像を機械的に補助することもできる。印刷中の強靭性および没出剤、補正剤およびUV光硬化性インクに対する耐性を高めるには、現像した板を短時間高温で加熱するとよい。

【0041】以下に、N, N-二置換スルホンアミド基を有する本発明の好ましいモノマー、それらのモノマーにより製造した重合体、およびその重合体を使用して製造した好ましい感光性混合物の例を説明するが、本発明はそれらの例に限定されるものではない。例中、 pbwは重量部を表す。

[0042]

#### 【実施例】

### モノマーの製造

【0043】b)N-(2-ヒドロキシエチル)-p-トルエンスルホンアミド8.9gをブタノン50 mlに溶解させた溶液に、氷冷しながら、無水メタクリル酸6.8mlおよびトリエチルアミン6.3 mlを滴下して加える。反応混合物が室温になった後、さらに4時間湿流させる。冷却後、酢酸エチルを加え、混合物を水洗し、有機相を分離して、硫酸マグネシウムで乾燥させる。回転蒸発装置で溶剤を除去した後、オイル[N-(2-メタクリロイルオキシエチル)-p-トルエンスルホンアミド]11.2gが残留する。このオイル状生成物は次の工程に直接使用できる。

【0044】c)前工程で得た粗製N-(2-メタクリロイルオキシエチル)-p-トルエンスルホンアミド1
1.8gを酢酸エチル50 mlに溶解させる。 攪拌しながら、最初に4-ジメチルアミノビリジン10 mgを室温で加え、続いて二炭酸ジーt-ブチル (ピロ炭酸ジーtーブチルエステル)9.2gを加える。反応終了後、反応混合物を10%NaOH水溶液で洗浄する。次いで有機相を分離して、MgSO a で乾燥させる。回転蒸発装置で溶剤を除去した後、僅かに着色したオイル [N-t-ブトキシカルポニル-N-(2-メタクリロイルオキシ

エチル) - p - トルエンスルホンアミド] 1 4 g が残留 オス

【0045】 「H-NMRスペクトル(60 MHz、溶剤としてCDC1」、化学シフトをδスケールで ppmで表し、プロトンの数を括弧内に示す):1.3 [9H]、
1.95 [3H]、2.45 [3H]、4.0-4.6
[4H]、5.55 [1H]、6.15 [1H]、7.
15-7.4 [2H]、7.65-7.95 [2H]。
【0046】 II. N-t-ブトキシカルボニルー4ーメ
9クリロイルオキシーN-フェニルペンゼンスルホンアミド

a) 4-ヒドロキシベンゼンスルホン酸のNa塩200 gを2N-NaOH水溶液500 mlに溶解させ、続いて水200 mlで希釈し、室温で攪拌しながら、クロロギ酸エチル120gを加える。混合物を一晩放置し、生じた沈殿(87g)を吸引濾別する。減圧下で溶剤を除去し、エタノールから再結晶させることにより、4-エトキシカルボニルオキシベンゼンスルホン酸のNa塩(白色固体)がさらに129g得られる。絵収量は216g(理論値の92%)である。

【0047】b)十分に乾燥させた、a)で得た4-エトキシカルボニルオキシベンゼンスルホン酸のNa塩95gをPC1。95gと良く混合する。反応混合物はこの処理中に液化し、発熱する。この混合物を油浴(浴温度115℃)中でさらに2時間加熱し、室温で一晩放置し、氷上に注ぎ、塩化スルホニルを吸引濾別する。大量の冷水で洗浄し、減圧下で乾燥させることにより、4-エトキシカルボニルオキシベンゼンスルホニルクロリド88g(理論値の94%)が、融点(mp.)71~72

【0048】c)アニリン340 mlを、撹拌しながら、少量ずつ、b)で得た4-エトキシカルボニルオキシベンゼンスルホニルクロリド84gと混合する。混合物を55℃に4時間加熱し、室温に冷却し、半濃縮塩酸1.7リットル中に注ぎ込む。一晩放置した後、水相をデカンテーションする。保護基を完全に取り除くために、残留物を2N-NaOH水溶液1.7リットル中に取り、不溶物質を分離し、HC1で酸性化することにより生成物を沈殿させる。吸引濾別し、H , Oで洗浄し、乾燥した後、4-ヒドロキシベンゼンスルホアニリド(白色固体、mp. 140℃)54.5g(理論値の70%)が得

【0049】 d) 工程 c)で製造した4-ヒドロキシベンゼンスルホアニリド50gをアセトン300 mlに溶解させ、無水メタクリル酸35.6gを加え、冷却、投拌しなが6、温度が10℃を超えない様にして、トリエチルアミン22.3gを滴下する。反応溶液を窒温にし、強く投拌しなが6、水3リットル中に滴下して加える。吸引違別し、乾燥させた後、4-メタクリロイルオキシベンゼンスルホアニリド(白色固体、mp.102~10

13

3℃) 61g (96%) が得られる。

【0050】e) 工程d) で製造した4-メタクリロイ ルオキシペンゼンスルホアニリド50gをアセトン30 Omlに溶解させ、撹拌しながら、 4 -ジメチルアミノビ リジン1gを加え、二炭酸ジーt-プチル38gをアセ トン100 mlに溶解させた溶液を滴下して加える。室温 で4時間攪拌し続け、H , 〇中に沈殿させる。吸引濾別 および乾燥の後、Nーt-プトキシカルポニルー4-メ タクリロイルオキシーN-フェニルベンゼンスルホンア ミド (白色固体、 mp. 112~114℃) 59g (90 %) が得られる。

14

【0051】NMRスペクトル(60 MHz、CDC l,):1.3 ppm(9H),2.1(3H),5.8 (1 H), 6.4 (1 H), 7.2-7.6 (7 H), 8.0-8.2(2H).

【0052】例1~20

Iおよび IIの単独重合、および様々なコモノマー、例え ばピロカテコールモノメタクリル酸エステル (PMA) やスチレン、を使用する共重合を、文献から公知の方法 により行う。表1はIおよび IIを(モル%で表示の量 10 で)使用して合成した重合体を示す。

[0053]

表1\_

例	I	II	PMA	スチレン
1	1 0	_	9 0	_
2	3 0	_	7 0	_
3	5 0	_	5 0	_
4	7 0	_	3 0	_
5	9 0	_	1 0	_
6	1 0	_	8 5	5
7	1 5	_	8 0	5
8	1 5	_	7 5	1 0
9	1 0	_	8 0	1 0
1 0	2 0	_	7 5	5
1 1	2 0	_	7 0	1 0
1 2	_	1 0	9 0	-
1 3	_	1 0	8 5	5
1 4	_	1 0	8 0	1 0
1 5	_	1 5	8 5	_
1 6	_	1 5	8 0	5
1 7	_	1 5	7 5	1 0
1 8	_	2 0	8 0	-
1 9	-	2 0	7 5	5
2 0	_	2 0	7 0	1 0

[0054] 例21~26\_

を示す。電気化学的に活性化し、アノード処理したアル ミニウムの板に

これらの例は、本発明による記録材料の製造および処理

メチルエチルケトン

表1に示すパインダー 4-p-トリルメルカプトー2,5-ジエトキシベンゼンジアゾニウムのヘキサ フルオロリン酸塩 クリスタルバイオレットペース

0.50 pbw 0.08 pbw

9.00 pbw

175 pbw

を含む溶液をスピンコーティングし、乾燥オープン中で 100℃に加熱して、層厚1.9µ m とする。この板を 110 cmの距離から5 kW ハロゲン化金属ランプの下 

> メタケイ酸ナトリウム・9 H 2 O リン酸三ナトリウム・12H 20 無水リン酸ーナトリウム

脱イオン水

【0055】すべての場合で、写真原画の陽画像が得ら

ンステップウェッジを通して露光し、次いで100℃で 1 分間加熱し、下記の組成を有する水性アルカリ現像剤 中で30秒間現像する。

5. 5 pbw

3. 4 pbw

0. 4 pbw

90.7 pbw

50 れる。表 2 は、ハーフトーンウェッジ 4 段目が完全にオ

ストAG)

板に

【0057】例27

この例は、N,N-二置換スルホンアミド基を含む重合

体のポジ型オフセット印刷板用としての適性を示す。電 気化学的に活性化し、アノード処理したアルミニウムの

15

ープンの状態で板上に再現される露光時間を示す。

# [0056]

## 表2

例	表1の重合体	露光時間 (秒)
2 1	8	3 0
2 2	10	3 0
23	11	3 5
2 4	18	2 0
2 5	15	18
2 6	17	3 0
比較*	<u> </u>	7.5

標準ポジ型印刷板商品名「オザゾール p61」(ヘキ

9.00 pbw 表1、No. 19に示すパインダー 4-p-トリルメルカプト-2, 5-ジエトキシベンゼン ジアゾニウムのヘキサフルオロリン酸塩 0.50 pbw 0.08 pbw クリスタルバイオ レットベース 175 pbw メチルエチルケトン

を含む溶液をスピンコーティングし、乾燥オープン中で 10 cmの距離から5 kW ハロゲン化金属ランプの下で、 **濃度ステップ0.15で13段を有するハーフトーンス** テップウェッジを通して20秒間露光し、次いで100

℃で1分間加熱しテ、水性アルカリ現像剤(組成につい 100℃に加熱し、層厚1.9 µ m とする。この板を1 20 ては例21~26参照)中で30秒間現像する。この様 にして得られたポジ型印刷版はオフセット印刷機械で1 70,000部を超える良品質の印刷を行う。